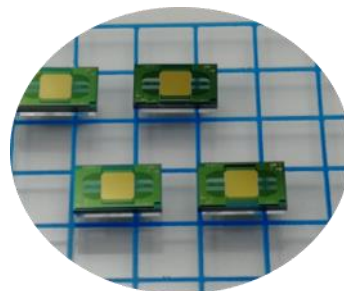


一维 MEMS 扫描镜规格书

1D MEMS Scanning Mirror

CSBL3



产品描述

一维 MEMS 扫描镜设计上采用高速共振模式，以达到大光学扫描角的性能，可实现光束一维空间的精确扫描；用户可根据实际应用的光学系统需求，选择合适的反射镜面尺寸及性能参数；镜面表面以金或铝为标准镀膜材料，为不同工作波长光束提供高反射率；若采用两颗一维 MEMS 扫描镜组合即可实现光束在二维空间的精确扫描，可实现高性能要求应用的开发。

产品特征

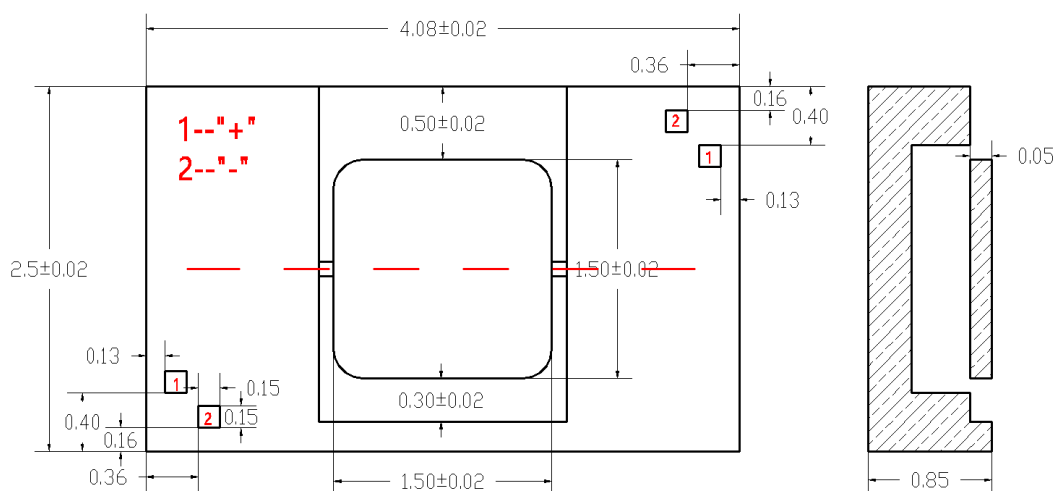
- 纯硅制造工艺
- 大扫描角度、高角度分辨率
- 高扫描频率
- 功耗低
- 稳定性、重复性好
- 抗冲击、抗振动
- 采用 MEMS 静电驱动原理
- 体积小、质量轻
- 成本低

产品应用

- 室内激光雷达 (LiDAR)
- 编码结构光投影器
- 生物医学检测
- 手势动作感测
- 其它

芯片参数

a) 芯片结构尺寸 (单位: mm)



b) 性能参数

参数	数值	单位
扫描频率	1950±100	Hz
工作电压	20-80	V
最大光学角	±50°	Degree
镜面反射率	>90	%
响应时间	<50	ms
镜面曲率	>5	m
功耗	<1	mW
工作温度	0-70	°C

芯片封装形式

MEMS 芯片产品, 其封装形式可以根据不同的使用需求进行定制化开发。我司可提供 1 种 (CLCC 封装, 如下图所示) 标准封装形式供客户使用。

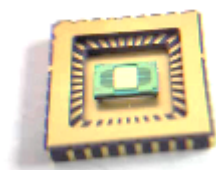


图 1 (b) CLCC 封装形式

➤ 驱动控制模块

一维 MEMS 扫描镜需要特殊的驱动控制模块, 我司可提供与之匹配的专业驱动控制模块, 可缩短客户对其开发周期。



图 2 (a) 驱动控制模块实物图